

ダイオキシン類未規制発生源調査結果

施 設	調査工場数	調査結果 (pg-TEQ/L)	
担体付き触媒の製造（塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。）の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設	8工場	廃ガス洗浄施設 （参考）総合排水	45 ~ 48 7.4 ~ 7.8
担体付き触媒（使用済みのものに限る。）からの金属の回収（ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する場合及びアルカリにより抽出する場合であって、かつ、焙焼炉で処理しない場合を除く。）の用に供する施設	6工場	ろ過施設 精製施設 廃ガス洗浄施設 （参考）総合排水	8.6 ~ 22 13 ~ 18 2.9 ~ 520,000 1.8 ~ 2.3
フロン類（特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令（平成6年政令第308号）別表1の項、3の項及び6の項に掲げる特定物質をいう。）の破壊（フロン類をプラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法に限る。）の用に供する施設	9工場	プラズマ反応施設 廃ガス洗浄施設 湿式集じん施設 （参考）総合排水	0.61 ~ 6,100 8.9 ~ 5,200 28 ~ 74 0.00042 ~ 1.5

（参考）ダイオキシン類対策特別措置法の水質排出基準：10 pg-TEQ/L